

FPD関連装置



(株)石井表記



PIインクジェット塗布装置

FPD用全自動PI用インクジェット・プリベーク装置

- ◆ 大型ガラス基板対応(G5.5~G10.5サイズ)
- ◆ 品種切換え容易(多品種対応)
- ◆ PI液の使用効率UP
- ◆ 省スペース軽量化



ワイエイシイ (株)



高密度プラズマエッチング装置

COSMOシリーズ

- ◆ 高密度プラズマ源TCPT™搭載
- ◆ 低圧条件下で幅広いプロセスウィンドウを実現
- ◆ 静電チャック(ESC)の採用でガラス基板の均一な温度制御が可能
- ◆ G5クラスまでの各種基板サイズに対応



SHINDO ENG., LAB. Ltd.



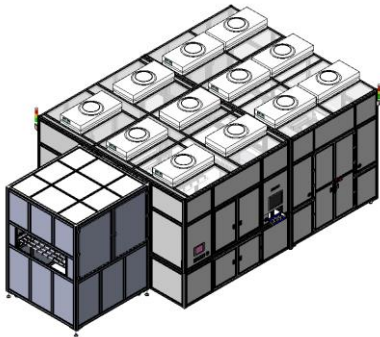
液晶用枚葉式加圧脱泡装置 /

タッチパネル・液晶用真空貼り合わせ装置(OCA/OCR)

- ◆ コンパクトな筐体
- ◆ スリムでシンプルな製造ライン
- ◆ 大型圧力タンク不要で安全管理が簡易
- ◆ 少ない消耗品・運用部品
- ◆ 柔軟なタクトタイム設定



Korea Semiconductor System.Co.,Ltd

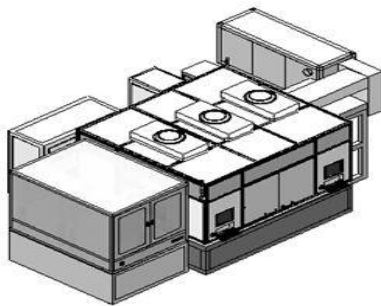


OGS 向け強化ガラスレーザー切断装置

- ◆ G2~G6 サイズガラス対応。
- ◆ 1pass full cutting (強化層、ガラス種類に関係なし)
- ◆ Cell、円形、自由曲線加工可能。
- ◆ 優れた断面品質(Roughness 5um以下)
- ◆ 早い切断速度(直線切断 500mm/s)
- ◆ サファイア切断加工可能。



Korea Semiconductor System.Co.,Ltd



Laser Lift Off 装置

- ◆ Excimer、UV レーザー両方とも対応可能。
- ◆ G6 Glassまで対応可能。
- ◆ Beam Size 調整可能。
- ◆ 安定的なLift Off性能。
- ◆ 実時間ビームモニタリング 可能。
- * その他 OLED向け Laser Sealing 装置。



Korea Semiconductor System.Co.,Ltd



Laser Drilling System

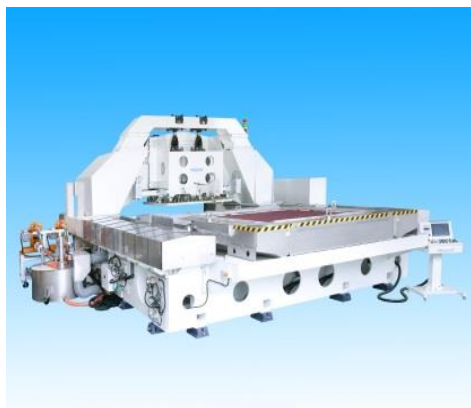
- ◆ PoP Laser Drilling Machine
- ◆ 4 Sources 4 Beams
- ◆ PRS_Pattern Recognition System
- ◆ High productivity with effective power control



セルモジュール工程関連装置

【主な取り扱い】

- ◆ LCD貼り合わせ基板一括分断装置
- ◆ エッジグラインダー
- ◆ チップボンディング前洗浄装置
- ◆ 偏光板貼り付け装置
- ◆ チップ、FPCボンディング装置
- ◆ シールディスペンサー
- ◆ 各種検査装置
- ◆ 洗浄・偏光板貼り付け・COG・FOG・検査全自動ライン等



フォトマスク用超大型両面研磨機

正方形軌跡運動機構採用の枚葉式両面研磨装置

- ◆ 高平坦度 : 基板全面の研磨速度一定
- ◆ 高剛性 : 基板へのストレス一定で高歩留まり
- ◆ 研磨速度 : 回転定盤方式に対し、高い研磨速度達成
- ◆ 操作性 : 下定盤高さ1430mm/FL(G8用)
- ◆ 省電力 : G6用-30KVA、G8用-72KVA



株式会社 UTKシステム

日本



樹脂チャンネル
G6ロールブラシサンプル

液晶、半導体向け精密工業ブラシ

ブラシ・研磨機を用いたトータルソリューション提供

- ◆ 液晶、半導体洗浄機用 精密洗浄ブラシの専門メーカー
- ◆ 大型液晶 洗浄装置用(G8以上) 大型ブラシの実績多数。
- ◆ 独自技術によるカーボンシャフトにより、回転による振れ、自重による撓みの大幅な軽減、交換作業の軽減。



株式会社 東設

日本

湿式除害装置



- ◆ 処理対象ガス $Cl_2, BCl_3, HCl, NH_3, F_2, HF, HBr$
- ◆ 薬剤不使用で塩素ガスのTLV値保証が可能
- ◆ 高い安全性
- ◆ 高効率ミキサーの使用
- ◆ ランニングコストが安価